

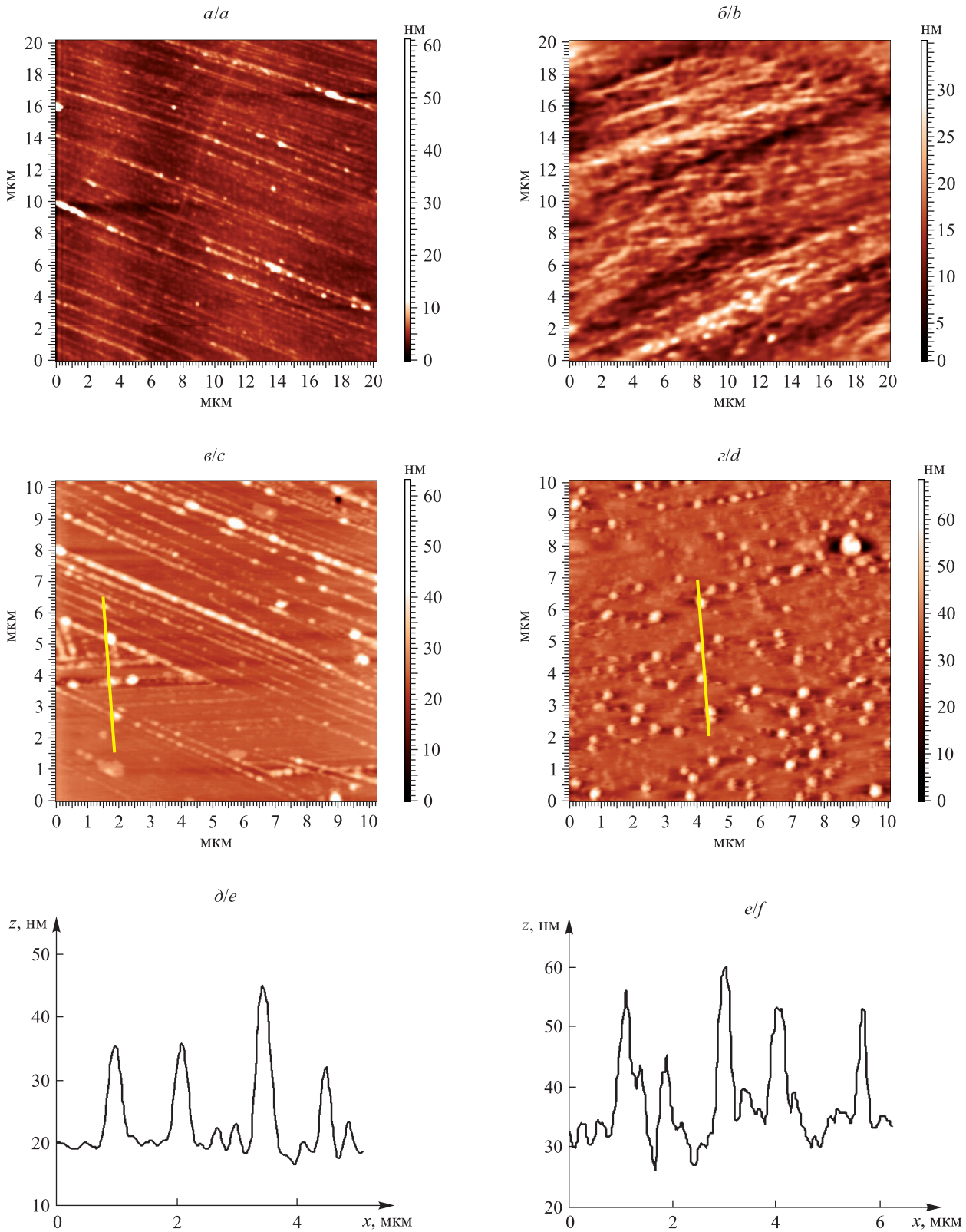


Рис. 4. АСМ-изображения поверхности кремниевой (а) и стеклянной (б) подложек, пленок оксида циркония, легированного оксидом иттрия, осажденных на кремниевую (в) и стеклянную (г) подложки. Профили сечения рельефа поверхности пленок вдоль выделенной линии, осажденных на кремниевую (д) и стеклянную (е) подложки

Fig. 4. AFM images of the surface silicon substrate (a), glass substrate (b), yttrium oxide doped zirconia film deposited on the silicon (c) and glass (d) substrates.

Profiles of the cross section of the surface relief of the films along the selected line deposited on a silicon (e) and glass (f) substrates